

Modulbezeichnung: Grundlagen der Messtechnik (GMT) 5 ECTS

(Fundamentals of Metrology)

Modulverantwortliche/r: Tino Hausotte

Lehrende: Assistenten, Tino Hausotte

Startsemester: SS 2014 Dauer: 1 Semester Turnus: halbjährlich (WS+SS)
Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch und Englisch

### Lehrveranstaltungen:

Fundamentals of Metrology - Grundlagen der Messtechnik (SS 2014, Vorlesung, 2 SWS, Tino Hausotte) Fundamentals of Metrology - Grundlagen der Messtechnik - Übung (SS 2014, Übung, 2 SWS, Tino Hausotte et al.)

#### Inhalt:

# Allgemeine Grundlagen

- Wesen des Messens: SI-Einheitensystem Definitionen der SI Einheiten (cd, K, kg, m, s, A, mol)
   Messung Extensive und intensive Größen Messen, Prüfen und Lehren objektives und subjektives Prüfen Grundvoraussetzungen für das Messen Weitergabe und Rückführung der Einheiten Gebrauch und korrekte Angabe der Einheiten Messwert, wahrer Wert, ausgegebener Wert Messabweichung
- Messprinzipien und Messmethoden: Messprinzip, Messmethode und Messverfahren Ausschlagmessmethode, Differenzmessmethode, Substitutionsmessmethode und Nullabgleichsmethode (Kompensationsmethode) direkte und indirekte Messmethoden analoge und digitale Messmethoden absolute und inkrementelle Messmethoden Auflösung und Empfindlichkeit Kennlinie und Kennlinienarten
- Statistik Auswertung von Messreihen: Berechnung eines Messergebnisses anhand von Messreihen Grundbegriffe der deskriptiven Statistik Darstellung und Interpretation von Messwertverteilungen (Histogramme) Häufigkeit (absolute, relative, kumulierte, relative kumulierte) Berechnung und Interpretation grundlegender Parameter: Lage (Mittelwert, Median, Modus), Streuung (Spannweite, Varianz, Standardabweichung), Form (Schiefe, Kurtosis bzw. Exzess) Stochastik und Verteilungen (Rechteck-, U- und Normalverteilung) statistische Tests und statistische Schätzverfahren Korrelation und Regression
- Messabweichungen und Messunsicherheit: Messwert, Wahrer Wert, vereinbarter Wert, erfasster Wert, ausgegebener Wert Einflüsse auf die Messung (Ishikawa-Diagramm) Messabweichung (systematische, zufällige) Korrektion bekannter systematischer Messabsweichungen Kalibrierung, Verifizierung, Eichung Messpräzision und Messgenauigkeit Wiederholbedingungen/-präzision, Vergleichsbedingungen/-präzision, Erweiterte Vergleichsbedingungen/-präzision Messunsicherheit korrekte Angabe eines Messergebnisses Übersicht über Standardverfahren des GUM (Messunsicherheit)

## Messgrößen des SI Einheitensystems

- Messen elektrischer Größen und digitale Messtechnik: Messung von Strom und Spannung (strom- und spannungsrichtige Messung), Bereichsanpassung - Wheatstonesche Brückenschaltung (Viertel-, Halb- und Vollbrücke, Differenzverfahren und Nullabgleichverfahren) - Charakteristische Werte sinusförmiger Wechselgrößen (Wechselspannungsbrücke) - Operationsverstärker (Invertierender Verstärker, Nichtinvertierender Verstärker, Impedanzwandler) - Digitalisierungskette (Filter, Abtast-Halte-Glied, Analog-Digital-Wandlung) - Abweichungen bei der Analog-Digital-Wandlung
- Messen optischer Größen: Licht und Eigenschaften des Lichtes Fotodetektoren (Fotowiderstände, Fotodioden) Empfindlichkeitsspektrum des Auges Radiometrie und Photometrie Lichtstärke (cd, candela) Strahlungsgesetze
- Messen von Temperaturen: Temperatur, SI-Einheit, Definition Wärmeübertragung (Wärmeleitung, Konvektion, Wärmestrahlung) Fixpunkte (Tripelpunkte, Erstarrungspunkte), Fixpunktzellen, internationale Temperaturskala (ITS-90) Berührungsthermometer Metall-Widerstandsthermometer, Messschaltungen für Widerstandsthermometer Thermoelemente, Messschaltungen für Thermoelemente Messabweichungen von Berührungsthermometern Strahlungsgesetze, Pyrometer (siehe

UnivIS: 26.05.2024 22:07



- Optische Größen) Messabweichungen von Pyrometern
- Zeit und Frequenz: Zeitmessung Atomuhr Globales Positionssystem Darstellung der Zeit Verbreitung der Zeitskala UTC Frequenz- und Phasenwinkelmessung
- Längenmesstechnik: Meterdefinition Abbesches Komparatorprinzip, Abweichungen 1.- und 2.Ordnung Längenmessung mit Linearencodern, Bewegungsrichtung, Ausgangssignale, Differenzsignale Absolutkodierung (V-Scannen und Gray Code) Interferometer, Michelson-Interferometer,
  Grundlagen der Interferenz, Homodynprinzip, Heterodynprinzip, Interferenz am Homodyninterferometer, destruktive und konstruktive Interferenz, Einfluss Luftbrechzahl
- Winkel und Neigung: ebener Winkel, Winkeleinheiten Maßverkörperungen Winkelmessgeräte
   Neigungsmessung optische Winkelmessgeräte Messabweichungen räumlicher Winkel, Raumwinkel
- Kraft und Masse: Definition SI-Einheit Kilogramm, Massenormale, Prinzip der Masseableitung

   Definition Masse, Kraft und Drehmoment Messprinzipien von Waagen Balkenwaage, Federwaage, Unter- und oberschalige Waagen, Ecklastabhängigkeit, DMS-Waage, EMK-Waage, Massekomparatoren Einflussgrößen bei Massebestimmung Kraftmessung, Kraftmessung mit DMS, magnetoelastische und piezoelektrische Kraftmessung

## Teilgebiete der industriellen Messtechnik

- Prozessmesstechnik (Druck und Durchfluss): Definition des Druckes Druckarten (Absolutdruck, Überdruck, Differenzdruck) Druckwaage (Kolbenmanometer), U-Rohrmanometer, Rohrfedermanometer, Plattenfedermanometer Drucksensoren (mit DMS, piezoresistiv, kapazitiv, piezoelektrisch) Durchflussmessung (Volumenstrom und Massestrom, Strömung von Fluiden) volumetrische Verfahren, Wirkdruckverfahren, Schwebekörper-Durchflussmessung, magnetisch-induktive Durchflussmessung, Ultraschall-Durchflussmessung Massedurchflussmessung (Coriolis, Thermisch)
- Fertigungsmesstechnik: Teilaufgaben der Fertigungsmesstechnik, Ziele der Fertigungsmesstechnik
   Gestaltparameter von Werkstücken (Mikro- und Makrogestalt), Gestaltabweichungsarten, Messen, Prüfen, Überwachen Gegenüberstellung klassische Messtechnik und Koordinatenmesstechnik, Standardgeometrieelemente Bauarten und Grundstruktur von Koordinatenmessgeräten Vorgehensweise bei Messen mit einem Koordinatenmessgerät
- Mikro und Nanomesstechnik: Anforderungen der Mikrosystemtechnik an die Messtechnik Sensoren und Tastsysteme für Mikrosystemtechnik (taktile Sensoren, opto-taktiler Fasertaster, Fokussensor, Chromatischer Weißlichtsensor) Rasterkraftmikroskop (Aufbau, Arbeitsweisen), Rastertunnelmikroskop Nanokoordinatenmessung: 3-D Realisierung des abbeschen Komparatorprinzips Maßnahmen zur Reduktion der Einflüsse

### Lernziele und Kompetenzen:

#### Lernziele

- Basiswissen zu Grundlagen der Messtechnik, messtechnischen Tä-tigkeiten, Beschreibung der Eigenschaften von Messeinrichtungen und Messprozessen, Internationales Einheitensystem und Rückführung von Messergebnissen.
- Grundkenntnisse zur methodisch-operativen Herangehensweise an Aufgaben des Messens statischer Größen, Lösen einfacher Mess-aufgaben und Ermitteln von Messergebnissen aus Messwerten

#### Kompetenzen

 Bewertung von Messeinrichtungen, Messprozessen und Messergeb-nissen sowie Durchführen einfacher Messungen statischer Größen.

#### Literatur:

- DIN e.V. (Hrsg.): Internationales Wörterbuch der Metrologie Grundlegende und allgemeine Begriffe und zugeordnete Benennungen (VIM) ISO/IEC-Leitfaden 99:2007. Beuth Verlag GmbH, 3. Auflage 2010
- Hoffmann, Jörg: Handbuch der Messtechnik. 4. Auflage, Carl Hanser Verlag München, 2012 ISBN 978-3-446-42736-5
- Lerch, Reinhard: Elektrische Messtechnik. 6. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012 ISBN 978-3-642-22608-3
- Richter, Werner: Elektrische Meßtechnik. 3. Auflage, Verlag Technik Berlin, 1994 ISBN 3-341-01106-4
- Kohlrausch, Friedrich: Praktische Physik: zum Gebrauch für Unterricht, Forschung und Technik.

UnivIS: 26.05.2024 22:07



- Band 1-3, 24. Auflage, Teubner Verlag, 1996 ISBN 3-519-23001-1, 3-519-23002-X, 3-519-23000-3
- Ernst, Alfons: Digitale Längen- und Winkelmesstechnik. 4. Auflage, Verlag Moderne Industrie, 2001
   ISBN 3-478-93264-5
- Pfeifer, Tilo: Fertigungsmeßtechnik. R. Oldenbourg Verlag München Wien, 1998 ISBN 3-486-24219-9
- Keferstein, Claus P.: Fertigungsmesstechnik. 7. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, 2011 ISBN 978-3-8348-0692-5
- Warnecke, H.-J.; Dutschke, W.: Fertigungsmeßtechnik. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Tokyo, 1984 - ISBN 3-540-11784-9

### Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar:

- [1] Berufspädagogik Technik (Bachelor of Science): 5. Semester (Po-Vers. 2010 | Bachelorprüfung | Grundlagen der Messtechnik)
- [2] Berufspädagogik Technik (Bachelor of Science): 5. Semester
  (Po-Vers. 2011 | Studienrichtung Metalltechnik | weitere Module der Studienrichtung | Produktion, Optik und
  Messtechnik | Grundlagen der Messtechnik)
- [3] Energietechnik (Bachelor of Science): 3. Semester (Po-Vers. 2011 | Bachelorprüfung | Grundlagen der Messtechnik)
- [4] Energietechnik (Bachelor of Science): 4. Semester (Po-Vers. 2013 | Bachelorprüfung | Grundlagen der Messtechnik)
- [5] Maschinenbau (Bachelor of Science): 5. Semester (Po-Vers. 2007 | Pflichtmodule | Grundlagen der Messtechnik)
- [6] Maschinenbau (Bachelor of Science): 2. Semester (Po-Vers. 2009s | Grundlagen- und Orientierungsprüfung | B 17 Grundlagen der Messtechnik)
- [7] Maschinenbau (Bachelor of Science): 5. Semester (Po-Vers. 2009w | Pflichtmodule | B 17 Grundlagen der Messtechnik)
- [8] Mechatronik (Bachelor of Science): 5. Semester (Po-Vers. 2007 | weitere Pflichtmodule | Grundlagen der Messtechnik)
- [9] Mechatronik (Bachelor of Science): 5. Semester (Po-Vers. 2009 | weitere Pflichtmodule | Grundlagen der Messtechnik)
- [10] Medizintechnik (Bachelor of Science): 3. Semester (Po-Vers. 2009 | Modulgruppen B5 und B8.1 - Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | Modulgruppe B8.1 - Vertiefungsmodule ET/INF | Grundlagen der Messtechnik)
- [11] Medizintechnik (Bachelor of Science): 3. Semester

  (Po-Vers. 2009 | Modulgruppen B6 und B8.2 Kompetenzfeld Gerätetechnik | Modulgruppe B6 Kernmodule |

  Grundlagen der Messtechnik)
- [12] Medizintechnik (Bachelor of Science)

  (Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B8
- Vertiefungsmodule ET/INF | Kernmodule aus dem Kompetenzfeld Gerätetechnik)

  [13] Medizintechnik (Bachelor of Science): 3. Semester

  (Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B6 Kernmodule | Grundlagen der Messtechnik)
- [14] Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science): 4-5. Semester (Po-Vers. 2007 | PO-Version 2007 | Bachelorprüfung | 1.-2. Ingenieurwissenschaftliches Wahlpflichtmodul in der Studienrichtung Maschinenbau | Grundlagen der Messtechnik)
- [15] Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science): 4-5. Semester
  (Po-Vers. 2008 | Studienrichtung Maschinenbau | weitere Bachelorprüfungen | Ingenieurwissenschaftlicher Bereich
  | Wahlbereich | 1.-2. Ingenieurwissenschaftliches Wahlpflichtmodul | Grundlagen der Messtechnik)
- [16] Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science): 4-5. Semester (Po-Vers. 2009 | Studienrichtung Maschinenbau | weitere Bachelorprüfungen | Ingenieurwissenschaftlicher Bereich | Wahlbereich | 1.-2. Ingenieurwissenschaftliches Wahlpflichtmodul | Grundlagen der Messtechnik)
- [17] Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science): 1-2. Semester (Po-Vers. 2009 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen | Studienrichtung Maschinenbau | Wahlpflicht- und

UnivIS: 26.05.2024 22:07



Vertiefungsmodul Modulgruppe 6 | Wahlpflichtmodul Modulgruppe 6 | Grundlagen der Messtechnik)

## [18] Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science): 1-2. Semester

(Po-Vers. 2009 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen | Studienrichtung Maschinenbau | 2.+3. Wahlpflichtmodul | Grundlagen der Messtechnik)

# Studien-/Prüfungsleistungen:

Grundlagen der Messtechnik (Prüfungsnummer: 45101) Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 60 Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%

weitere Erläuterungen:

Prüfungstermine, eine allgemeine Regel der Prüfungstagvergabe und Termine der Klausureinsicht finden Sie auf StudOn: Prüfungstermine und Termine der Klausureinsicht

Erstablegung: SS 2014, 1. Wdh.: WS 2014/2015

1. Prüfer: Tino Hausotte

### Organisatorisches:

• Unterlagen zur Lehrveranstaltung werden auf der Lernplattform StudOn (www.studon.uni-erlangen.de) bereitgestellt. Das Passwort wird in der ersten Vorlesung bekannt gegeben.

UnivIS: 26.05.2024 22:07 4